PAT-NO:

JP354049599A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 54049599 A

TITLE:

HIGH MOLECULAR PIEZO-ELECTRIC BODY AND METHOD OF

FABRICATING THE SAME

**PUBN-DATE:** 

April 18, 1979

INVENTOR-INFORMATION: NAME TAMURA, SAKAE YOSHIOKA, HIROSHI FUJIMORI, YOSHINORI FUJIWARA, SHIGERU

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

**COUNTRY** 

**TOSHIBA CORP** 

N/A

APPL-NO:

JP52115193

APPL-DATE:

September 27, 1977

INT-CL (IPC): H01L041/18

US-CL-CURRENT: 29/25.35

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To provide the subject piezo-electric body wherein a mesh-like high molecular layer is provided on the surface of a chain high molecular layer by plasma polymerization or glow polymerization, and is subjected to polarization treatment, thereby to obtain a thin piezo-electric membrane of high piezo-electric moduls excellent in electrical machine conversion efficiency and small in piezo-electric anisotropy.

CONSTITUTION: A mesh-like high molecular layer obtained by plasma polymerization or glow polymerization of a vinyl monomer and a polymer of methane, ethane, propane, toluenenaphthalin, anthracene or the like is provided on the surface of a chain high molecular layer such as polyester, polyethylene, vinylidene polyfuoride. To both surfaces of a resin layer fabricated by laminating the above described layers alternately suitably in two or three layers there are attached electrodes, and the thus obtained piezo-electric body is then subjected to polarization. The piezo-electric body prepared by the above described procedure manifests excellent piezo-electric characteristic without subjecting the same to elongation treatment, and even when it is

subjected to elongation treatment, no anisotropy is produced. A desired configuration of the piezo- electric body can be obtained. Particularly, in the case of using plasma polymerization, a uniform thin layer is easily obtained

COPYRIGHT: (C)1979,JPO&Japio

#### (9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑩公開特許公報 (A)

昭54-49599

⑤Int. Cl.²
H 01 L 41/18

識別記号 ��日本分類 102 **62 C 0** 100 B 1

庁内整理番号 43公開 昭和54年(1979)4月18日 7131-5F

> 発明の数 2 審査請求 有

> > (全 3 頁)

### 図高分子圧電体およびその製造方法

②特 願 昭52-115193

②出 願 昭52(1977)9月27日

⑩発 明 者 田村栄

川崎市幸区小向東芝町1 東京 芝浦電気株式会社総合研究所内

同 吉岡浩

川崎市幸区小向東芝町1 東京 芝浦電気株式会社総合研究所内 仰発 明 者 藤森良経

川崎市幸区小向東芝町 1 東京 芝浦電気株式会社総合研究所内

同 藤原茂

川崎市幸区小向東芝町1 東京 芝浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

⑪代 理 人 弁理士 則近憲佑 外1名

#### 明 細 暫

- 1. 発明の名称 高分子圧電体およびその製造方法
- 2. 特許請求の範囲

1) 鎖状高分子層と、網目状局分子層とを交互に 程度してなる樹脂層からなり、かつ削記樹脂層が 分割されていることを特徴とした高分子圧电体。

2) 鎖状高分子瘤表面にプラズマ重合もしくはグロー重合により網目状高分子瘤を設け、鎖状高分子層と結びしてなる樹脂瘤を 子層と納目状高分子層とを被解してなる樹脂瘤を 形成する工程と、前配樹脂瘤を分配する工程とを 具備したことを特徴とする高分子圧偏体の製造方法。

3. 発明の評細な説明

١

本知明は、圧電特性を改善した高分子圧電体をよびその製造方法に関する。

従来高分子圧を体は例えばポリペンジングルタメート、ポリメタルグルタメート、ポリ那化ビニリデン、ボリ塩化ビニル、ボリ那化ビニルなど値性高分子フィルムに一軸延伸など適当な削処理を 加とした後、直旋高を昇下で分値することにより 待られた。

この欠点を改良する目的によって現化ビニリデンと四弗化エチレンを共立合して得られる樹脂を(A)フィルム状に加工し無延伸のまま分核処理する方法(特公昭 5 0 - 2 9 1 5 9) や、(B) 製酵製体 散粒子を高分子化合物中に分散させたシートを分極処理する方法(特公 5 1 - 1 0 3 9 ) 等が提案されて、電子を表方法によって得られた圧製体の圧製をありませば、一軸延伸高分子圧製体の圧製をあり

特開昭54-49599(2)

性と比較して、著しく小さいことが示されているが、(A)の場合はアセトンやジメチルオルムアミドの裕液として逐板にコーテイングするため、脱裕鉄に投時間を要し、かつピンホールが発生しやすいために分極電圧を高くできず、高い圧電率は待られなかった。

また、(B)の場合は粒子径を圧電性を示す戦小の粒子径(約14m)より海く出来ず圧電体膜の厚みは粒子径によって制限されることと、単位面積当りの質量が大きいために、電気一般研変換効率が、高分子圧電体よりも劣みという欠点を有していた。

本発明は圧電率異方性が小さく圧電特性が著し く改良された高分子圧电体およびその製造方法を 提供することを目的とする。

本発明は鎖状高分子層と網目状高分子層とを被陷した樹脂層を分極して成る高分子圧組体およびあらかじめ設けた鎖状元分子層表回に、プラズマ宣合もしくはグロー重合により納目状高分子層を設けた後分極処理を施す高分子圧電体の設置方法である。

(3)

また不発明の高分子比較体では、圧電体の形状を任意に行られ、特にブラズマ原合などを用いた 動合には均一な脚脳が容易に得られ実用上極めて 有効なものと質える。

以下余白

つまり本気明は例えば、ポリエステル、ポリエチレン、ポリ邪化ビニリデンなどの鎖状為分子簡 級面に、例えばビニルモノマおよびメタン、エタン、プロパン、トルエンナフタリン、アントラセンなどの重合体のプラズマ重合(例えばジャーナル・オブ・アプライド・ポリマー - Journal of Applied Polymer Sei 17 2501~2507(1973)、ジャーナル・オブ・アプライト・フイジックスーJounal of Applied Physics Vol 44,4317~4321(1973)など)により待た納目状高分子層を設けるというものであり、本発明に係る高分子圧電体では従来の如く延伸処理による圧電率換方性を生じることなく做れた圧電性を得ることができるなものと当える。

なお従来の高分子圧値体の圧電特性が、内部ひ すみによる圧値性や、自発分極による巨視的ひず み依存性による圧電性に起因するものと考えられ ているのに対し、本発明における圧値性は高分子 圧电体の不均一性によるものと推定される。

(4)

	第1の転船	第2の両脂	被海回数	関係回数 フィルムの 田鶴定数	田職定数	異方件の
				4年四年	(431) (UGSesu)	¥
	ボリ雑化ビニ	ポリザ化ビニ 四悪化エチレンの			無常命	
1	- デジ	ブラズマ重合体	9	1 0 # m	9.2×10-7	# #
<b>米部约-1</b>				,	1.5布帛伊8.8×10-7	
	ポリエステル	ボリエステル エチレンのブラズ			無延伸	
		マ重合体	9	2 0 4m	1.2×10-7	無
<b>米稲包-2</b>		:			2倍处伸	
					1.4×10-7	
i	ギッ エチアン	ポリエチンン、エチンンのブラズ	•	1	無処仰	1
英施例-3		<b>~</b> 重合体	4	10041	6.5×10 <sup>-8</sup>	<b>*</b>
. i	ボリ班代とニ	ボリ形化ビニトルエンのブラズ	,	E	無処伸	#
* 1 2 2 3 × 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	リデン	<b>▽聖合体</b>	,	1 1	5 × 10-8	

炭

## 特開昭54-49599(3)

この結果本発明に係る向分子圧鉱体では無伸処理を施すことなく飲れた圧壌性を示し延伸処理による圧壌率の向上は認められなかった。 さらに比較例-1,2の如く成分子圧鉱体を厚くすることなく海峡化も極めて容易になるといりものである。 以上の如く本発明の尚分子圧鉱体では、従来の

(8)

/	第1の貨脂	第2の戦脂	養層回数	-	压電定数	吳加
				合町厚み	(d31) (OGSesu)	態を
	151 - T-7 JAN		-		2倍延伸	
北敦河1	ノルタメート の 2009延申フィルム			2002 m 4002	1.4×10-8	無
	ボリングなニッドンと				無処仰	
( )	大文献(100g)		-		40×10-8	¥
九数名 - 2	@(8001)74(i>		-	III # 0 0 7	3倍位中	₹.
	の衛合物			,		
		エチレンのブラ	· u	0.0	1 0 - 1 0 M.	
九数包-3	が.りイミド	ズマ更合体	0	2.0 4.111	<u> </u>	
4	4	フッ化ビニリデン	,	## % C -	1 0 " m 1 0-1 012 F:	
元数別しま	47156	のブラズマ軍台体	,		ξ -	
4	/* * * * +	フッ化とニリデン	,	# 17 C	T.100.T	
元数20一5	~ // /	のプラスマ覧合体	4	III # 0 7		
( -	アッ化ビニリデン	は他にエナフンの	6	# T	1.0-10以下	載
九大村 七 6	のフラズマ重合体	フラズマ政治体	) )			

(7)

如く延伸処理を施すことなく使れた圧成性が得られさらに圧迫体の形状を任意に遊訳でき、さらに本端明方法を用いることにより級 4m 程度の局分子 圧電体も容易に得ることができ来尽上値めて有効なものと言える。

代理人 弁理士 則 近 憲 佑

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☑ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потивр.

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.